

簡稱	HR-TEM
中文名稱	高解析穿透式電子顯微鏡
英文名稱	High Resolution Transmission Electron Microscope
圖片	
功能說明	試片表面及截面幾何外觀檢測、樣品晶格分析、選區繞射分析、元素鑑別及分佈分析、材質含金屬及無機物 TEM特點(下載)
儀器服務項目	明場影像、暗場影像、晶格繞射影像、成分定性及半定量分析、元素Mapping及Linscan分析
儀器購置日期	2020/10/20
儀器廠牌	日本電子公司JEOL
型號	JEM-2100Plus
儀器規格	1.點解析度 $\leq 0.23\text{nm}$ 2.加速電壓：200KV,160KV,120KV,100KV,80KV 3.電子槍型式：LaB ₆ 單晶 4.放大倍率：x30 ~ x1,500k
主要配件	能量發散光譜儀(EDS)、掃描穿透影像裝置(STEM)、雙傾角鍍質載台
樣品準備	粉末及FIB切片樣品(請將樣品置於直徑3mm銅網或鎳網上並乾燥)
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.樣品需乾燥，若需特殊處理，需先自行製備。 2.試片在電子束照射下會分解或釋放氣體，因有礙必要之真空維持，恕不受理。 3.本儀器拒絕受理含磁性、腐蝕性、高分子、揮發性、生物及不耐高溫之試件。 4.需自備空白光碟片儲存資料 <p>本儀器拒絕受理具強磁性或易被電磁透鏡吸引的粉末型式樣品或材料;亦拒絕受理含有毒性、腐蝕性、揮發性、生物性及低熔點之樣品。如未告知違規樣品造成儀器損傷，會向使用者單位請求賠償。</p>
儀器放置位置	工程三館 ES105